



KINTEK FURNACE

## Cvd & Pecvd Furnace Каталог

Contact us for more catalogs of [High Temperature Furnaces](#), и т. д.

# KINTEK FURNACE

## ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

### >>> О нас

Kintek Furnace - это технологический новатор, специализирующийся на прецизионном высокотемпературном лабораторном оборудовании, включая муфельные печи, трубчатые печи, вакуумные печи, системы с контролем атмосферы и передовые решения для CVD/PECVD. Разработанные для материаловедения, химических исследований и термической обработки, наши надежные и энергоэффективные системы обеспечивают точность, безопасность и воспроизводимость в экстремальных температурных условиях, позволяя исследователям и промышленным лабораториям добиваться революционных результатов.



# Радиочастотная Система PECVD Радиочастотное Плазменное Химическое Осаждение Из Паровой Фазы

Артикул: KT-RFPE



## введение

Система KINTEK RF PECVD: Прецизионное осаждение тонких пленок для полупроводников, оптики и МЭМС. Автоматизированный низкотемпературный процесс с превосходным качеством пленки. Возможны индивидуальные решения.

[Узнать больше](#)

<p>Форма оборудования</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Коробчатый тип: горизонтальная верхняя крышка открывает дверь, а камера осаждения и камера выхлопа являются цельносварными;</li> <li>• Вся машина: главный двигатель и электрический шкаф управления имеют интегрированную конструкцию (вакуумная камера находится слева, а электрический шкаф управления - справа).</li> </ul>
<p>Вакуумная камера</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Размеры: Ф420 мм (диаметр) × 400 мм (высота); изготовлена из высококачественной нержавеющей стали SUS304 0Cr18Ni9, внутренняя поверхность отполирована, требуется тонкая работа без грубых паяных соединений, на стенке камеры имеются трубы для охлаждающей воды;</li> <li>• Порт для отвода воздуха: Двухслойная сетка из нержавеющей стали 304 с интервалом 20 мм спереди и сзади, противообращающая перегородка на штоке высокого клапана и пластина для выравнивания воздуха в устье выхлопной трубы для предотвращения загрязнения;</li> <li>• Метод герметизации и экранирования: дверь верхней камеры и нижняя камера запечатаны уплотнительным кольцом для герметизации вакуума, а сетевая трубка из нержавеющей стали используется снаружи для изоляции источника радиочастот, экранируя вред, причиняемый радиочастотными сигналами людям;</li> <li>• Окно наблюдения: Два 120-миллиметровых смотровых окна установлены спереди и сбоку, стекло с защитой от обгорания устойчиво к высокой температуре и радиации, что удобно для наблюдения за субстратом;</li> <li>• Режим воздушного потока: левая сторона камеры накачивается молекулярным насосом, а правая - воздухом, образуя конвективный режим работы зарядки и откачки, чтобы газ равномерно поступал к поверхности мишени и попадал в область плазмы для полной ионизации и осаждения углеродной пленки;</li> <li>• Материал камеры: корпус вакуумной камеры и выпускное отверстие изготовлены из высококачественной нержавеющей стали SUS304 0Cr18Ni9, верхняя крышка изготовлена из алюминия высокой чистоты для уменьшения веса верхней части.</li> </ul>
<p>Скелет хозяина</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изготовлен из профильной стали (материал: Q235-A), корпус камеры и электрический шкаф управления имеют интегрированную конструкцию.</li> </ul>
<p>Система водяного охлаждения</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Трубопровод: Основные впускные и выпускные водораспределительные трубы изготовлены из труб из нержавеющей стали;</li> <li>• Шаровый клапан: Все охлаждающие компоненты снабжаются водой отдельно через 304 шаровые краны, трубы входа и выхода воды имеют цветовые различия и соответствующие знаки, а 304 шаровые краны для труб выхода воды могут быть открыты и закрыты отдельно; Мишень, источник питания RF, стенки камеры и т.д. оснащены защитой от потока воды, и есть сигнализация отключения воды для предотвращения блокировки водопровода. Все сигналы тревоги о потоке воды отображаются на промышленном компьютере;</li> <li>• Индикация потока воды: Нижняя часть имеет контроль расхода воды и температуры, а температура и расход воды отображаются на промышленном компьютере;</li> <li>• Температура холодной и горячей воды: когда пленка оседает на стенке камеры, холодная вода пропускается через 10-25 градусов для охлаждения воды, и она продвигается вперед, когда дверь камеры открывается. Через горячую воду пропускается 30-55 градусов теплой воды.</li> </ul>

Шкаф управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Структура: приняты вертикальные шкафы, шкаф для установки приборов представляет собой 19-дюймовый шкаф управления международного стандарта, а шкаф для установки других электрических компонентов представляет собой большую панельную структуру с задней дверью;</li> <li>• Панель: Основные электрические компоненты в шкафу управления отбираются у производителей, прошедших сертификацию CE или ISO9001. Установите набор розеток на панели;</li> <li>• Метод подключения: шкаф управления и хост имеют слитную структуру, левая сторона - корпус помещения, правая - шкаф управления, нижняя часть оснащена специальным гнездом для проводов, высокого и низкого напряжения, а радиочастотный сигнал разделяется и направляется для уменьшения помех;</li> <li>• Низковольтная электрика: Французский Schneider воздушный выключатель и контактор для обеспечения надежного питания оборудования;</li> <li>• Розетки: Запасные розетки и розетки для приборов установлены в шкафу управления.</li> </ul>
Предельный вакуум	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Атмосфера до <math>2 \times 10^{-4}</math> Па <math>\leq 24</math> часа, (при комнатной температуре, и вакуумная камера чистая).</li> </ul>
Время восстановления вакуума	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Атмосфера до <math>3 \times 10^{-3}</math> Па <math>\leq 15</math> мин (при комнатной температуре, вакуумная камера чистая, с перегородками, зонтичными подставками и без подложки).</li> </ul>
Скорость повышения давления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\leq 1,0 \times 10^{-1}</math> Па/ч</li> </ul>
Конфигурация вакуумной системы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Состав комплекта насосов: обратный насос BSV30 (Ningbo Boss) + насос Рутса BSJ70 (Ningbo Boss) + молекулярный насос FF-160 (Beijing);</li> <li>• Метод откачки: откачка с помощью устройства мягкой откачки (для уменьшения загрязнения субстрата во время откачки);</li> <li>• Соединение труб: труба вакуумной системы изготовлена из нержавеющей стали 304, а мягкое соединение трубы выполнено из;</li> <li>• Металлический сильфон; каждый вакуумный клапан является пневматическим клапаном;</li> <li>• Порт всасывания воздуха: Чтобы предотвратить загрязнение молекулярного насоса мембранным материалом во время процесса испарения и повысить эффективность откачки, между всасывающим отверстием корпуса камеры и рабочим помещением используется подвижная изолирующая пластина, которую легко разобрать и очистить.</li> </ul>
Измерение вакуумной системы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Индикатор вакуума: три низких и один высокий (3 группы регулирования ZJ52 + 1 группа регулирования ZJ27);</li> <li>• Высоковакуумный манометр: Ионизационный манометр ZJ27 установлен на верхней части насосной камеры вакуумного бокса рядом с рабочей камерой, диапазон измерения составляет от <math>1,0 \times 10^{-1}</math> Па до <math>5,0 \times 10^{-5}</math> Па;</li> <li>• Низковакуумные манометры: один комплект манометров ZJ52 установлен на верхней части откачной камеры вакуумного бокса, а другой комплект установлен на трубе грубой откачки. Диапазон измерений составляет от <math>1,0 \times 10^{+5}</math> Па до <math>5,0 \times 10^{-1}</math> Па;</li> <li>• Рабочее регулирование: CDG025D-1 емкостной пленочный манометр установлен на корпусе камеры, и диапазон измерения составляет от <math>1,33 \times 10^{-1}</math> Па до <math>1,33 \times 10^{+2}</math> Па, обнаружение вакуума во время осаждения и нанесения покрытия, используется в сочетании с постоянным вакуумом бабочка клапан использования.</li> </ul>
Работа вакуумной системы	<p>Существует два режима выбора вакуума - ручной и автоматический;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Японский ПЛК Omron управляет всеми насосами, действием вакуумного клапана, а также блокировкой работы запорного клапана для обеспечения автоматической защиты оборудования в случае неправильной работы;</li> <li>• Высокий клапан, низкий клапан, предварительный клапан, высокий клапан перепускной клапан, в положении сигнал отправляется в PLC сигнал управления, чтобы обеспечить более комплексную функцию блокировки;</li> <li>• Программа ПЛК может выполнять функцию сигнализации каждой точки неисправности всей машины, такой как давление воздуха, поток воды, сигнал двери, сигнал защиты от перегрузки по току и т.д. и сигнализации, так что проблема может быть найдена быстро и удобно;</li> <li>• 15-дюймовый сенсорный экран является верхним компьютером, а ПЛК - нижним компьютером мониторинга и управления клапаном. Онлайн-мониторинг каждого компонента и различные сигналы своевременно отправляются обратно в программное обеспечение конфигурации промышленного управления для анализа и суждения, а также записываются;</li> <li>• Когда вакуум становится ненормальным или отключается питание, молекулярный насос вакуумного клапана должен вернуться в закрытое состояние. Вакуумный клапан оснащен функцией защиты от блокировки, а вход воздуха в каждый цилиндр оснащен устройством регулировки отсечного клапана, и есть положение, установленное датчиком для отображения закрытого состояния цилиндра;</li> </ul>
Вакуумный тест	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В соответствии с общими техническими условиями GB11164 вакуумной машины для нанесения покрытий.</li> </ul>

# Печь С Разделенной камерой Cvd Трубки С Вакуумной Станцией Cvd Машины

Артикул: КТ-СТФ12



## введение

Трубчатая печь CVD с разделенной камерой и вакуумной станцией - высокоточная лабораторная печь с температурой 1200°C для исследования современных материалов. Доступны индивидуальные решения.

[Узнать больше](#)

<b>Модель печи</b>	<b>КТ-СТФ12-60</b>
Макс. температура	1200°C
Постоянная рабочая температура	1100°C
Материал трубки печи	Высокая чистота кварца
Диаметр трубки печи	60 мм
Длина зоны нагрева	1x450 мм
Материал камеры	Японское глиноземное волокно
Нагревательный элемент	проволочная спираль из Cr2Al2Mo2
Скорость нагрева	0-20°C/мин
Тепловая пара	Встроенный тип К
Контроллер температуры	Цифровой ПИД-регулятор/ПИД-регулятор с сенсорным экраном
Точность регулирования температуры	±1°C
Расстояние скольжения	600 мм
<b>Блок точного контроля газа</b>	
Расходомер	Массовый расходомер MFC
Газовые каналы	4 канала
Расход	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCCM CH4 MFC3: 0- 100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
Линейность	±0,5% F.S.
Повторяемость	±0,2% F.S.
Трубопровод и клапан	Нержавеющая сталь
Максимальное рабочее давление	0,45 МПа
Контроллер расходомера	Контроллер с цифровой ручкой/контроллер с сенсорным экраном
<b>Стандартный вакуумный блок (опция)</b>	
Вакуумный насос	Пластинчато-роторный вакуумный насос

Расход насоса	4L/S
Вакуумный порт всасывания	KF25
Вакуумметр	Кремниевый вакуумметр Пирани/Резистанс
Номинальное вакуумное давление	10Па
<b>Установка высокого вакуума (опция)</b>	
Вакуумный насос	Пластинчато-роторный насос+молекулярный насос
Расход насоса	4L/S+110L/S
Порт всасывания вакуума	KF25
Вакуумметр	Комбинированный вакуумметр
Номинальное вакуумное давление	6x10 <sup>-5</sup> Pa
Выше спецификации и установки могут быть настроены	

Нет.	Описание	Количество
1	Печь	1
2	Кварцевая трубка	1
3	Вакуумный фланец	2
4	Тепловой блок трубки	2
5	Крючок трубчатого термоблока	1
6	Термостойкая перчатка	1
7	Точный контроль газа	1
8	Вакуумный блок	1
9	Руководство по эксплуатации	1

# Машина Печи Трубки Cvd С Несколькоими Зонами Нагрева Для Оборудования Химического Осаждения Из Паровой Фазы

Артикул: КТ-СТФ14



## введение

Многозональные трубчатые CVD-печи KINTEK обеспечивают точный контроль температуры для современного осаждения тонких пленок. Идеально подходят для исследований и производства, настраиваются под нужды вашей лаборатории.

[Узнать больше](#)

Модель печи	КТ-СТФ14-60
Макс. температура	1400°C
Постоянная рабочая температура	1300°C
Материал трубки печи	Высокая чистота Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> трубки
Диаметр трубки печи	60 мм
Зона нагрева	2x450 мм
Материал камеры	Алюмооксидное поликристаллическое волокно
Нагревательный элемент	Карбид кремния
Скорость нагрева	0-10°C/мин
Тепловая пара	тип S
Регулятор температуры	Цифровой ПИД-регулятор/ПИД-регулятор с сенсорным экраном
Точность регулирования температуры	±1°C
<b>Газовый точный блок управления</b>	
Расходомер	Массовый расходомер MFC
Газовые каналы	4 канала
Расход	MFC1: 0-5SCCM O <sub>2</sub> MFC2: 0-20SCCM H <sub>4</sub> MFC3: 0- 100SCCM H <sub>2</sub> MFC4: 0-500 SCCM N <sub>2</sub>
Линейность	±0,5% F.S.
Повторяемость	±0,2% F.S.
Трубопровод и клапан	Нержавеющая сталь
Максимальное рабочее давление	0,45 МПа
Контроллер расходомера	Цифровой регулятор/контроллер с сенсорным экраном

**Стандартный вакуумный блок (опция)**

Вакуумный насос	Пластинчато-роторный вакуумный насос
Расход насоса	4L/S
Вакуумный порт всасывания	KF25
Вакуумметр	Кремниевый вакуумметр Пирани/Резистанс
Номинальное вакуумное давление	10Па
Установка высокого вакуума (опция)	
Вакуумный насос	Пластинчато-роторный насос+молекулярный насос
Расход насоса	4L/S+110L/S
Порт всасывания вакуума	KF25
Вакуумметр	Комбинированный вакуумметр
Номинальное вакуумное давление	6x10-5Pa

Вышеуказанные спецификации и настройки могут быть изготовлены на заказ

Нет.	Описание	Количество
1	Печь	1
2	Кварцевая трубка (или другой материал по заказу)	1
3	Комплект вакуумных фланцев	2
4	Тепловой блок трубки	2
5	Крючок трубчатого термоблока	1
6	Термостойкая перчатка	1
7	Блок точного контроля газа (если заказывается)	1
8	Вакуумный блок (если заказывается)	1
9	Руководство по эксплуатации	1

# Изготовленная На Заказ Универсальная Печь Трубки Cvd Химическое Осаждение Паров Cvd Оборудование Машина

Артикул: KT-CTF16



## введение

Трубчатая CVD-печь KINTEK обеспечивает точный контроль температуры до 1600°C, идеально подходящий для осаждения тонких пленок. Настраивается для исследовательских и промышленных нужд.

[Узнать больше](#)

<b>Модель печи</b>	<b>KT-CTF16-60</b>
Макс. температура	1600°C
Постоянная рабочая температура	1550°C
Материал трубки печи	Высокая чистота Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> трубки
Диаметр трубки печи	60 мм
Зона нагрева	3x300 мм
Материал камеры	Алюмооксидное поликристаллическое волокно
Нагревательный элемент	Карбид кремния
Скорость нагрева	0-10°C/мин
Тепловая пара	тип S
Регулятор температуры	Цифровой ПИД-регулятор/ПИД-регулятор с сенсорным экраном
Точность регулирования температуры	±1°C
<b>Газовый точный блок управления</b>	
Расходомер	Массовый расходомер MFC
Газовые каналы	3 канала (настраиваемые)
Расход (пример)	MFC1: 0-5SCCM O <sub>2</sub> MFC2: 0-20SCCM CH <sub>4</sub> MFC3: 0- 100SCCM H <sub>2</sub> MFC4: 0-500 SCCM N <sub>2</sub> (настраивается)
Линейность	±0,5% F.S.
Повторяемость	±0,2% F.S.
Трубопровод и клапан	Нержавеющая сталь
Максимальное рабочее давление	0,45 МПа
Контроллер расходомера	Контроллер с цифровой ручкой/контроллер с сенсорным экраном
<b>Стандартный вакуумный блок (опция)</b>	
Вакуумный насос	Пластинчато-роторный вакуумный насос
Расход насоса	4L/S

Вакуумный порт всасывания	KF25
Вакуумметр	Кремниевый вакуумметр Пирани/Резистанс
Номинальное вакуумное давление	10Па
<b>Высоковакуумный блок (опция)</b>	
Вакуумный насос	Пластинчато-роторный насос+молекулярный насос
Расход насоса	4L/S+110L/S
Порт всасывания вакуума	KF25
Вакуумметр	Комбинированный вакуумметр
Номинальное вакуумное давление	6x10 <sup>-5</sup> Pa

Вышеуказанные характеристики и настройки могут быть выполнены по индивидуальному заказу

Нет.	Описание	Количество
1	Корпус печи с регулятором температуры	1
2	Высокочистый глинозем или кварцевая трубка (согласно заказу)	1
3	Вакуумные уплотнительные фланцы с портами	2 комплекта
4	Тепловые блоки/заглушки для трубок	2
5	Крючок для термоблока трубки	1
6	Термостойкие перчатки	1 пара
7	Точный блок управления газом (МФЦ согласно заказу)	1 комплект
8	Вакуумный блок (насос и манометр по заказу)	1 комплект
9	Руководство по эксплуатации	1

# Слайд Ресvd Трубчатая Печь С Жидким Газификатором Ресvd Машина

Артикул: KT-PE12



## введение

Трубчатая печь KINTEK Slide PECVD: прецизионное осаждение тонких пленок с помощью радиочастотной плазмы, быстрая термоциклическая обработка и настраиваемый контроль газа. Идеально подходит для полупроводников и солнечных батарей.

[Узнать больше](#)

Модель печи	KT-PE12-60
Макс. температура	1200°C
Постоянная рабочая температура	1100°C
Материал трубки печи	Высокая чистота кварца
Диаметр трубки печи	60 мм
Длина зоны нагрева	1x450 мм
Материал камеры	Японское глиноземное волокно
Нагревательный элемент	проволочная спираль из Cr2Al2Mo2
Скорость нагрева	0-20°C/мин
Тепловая пара	Встроенный тип К
Контроллер температуры	Цифровой ПИД-регулятор/ПИД-регулятор с сенсорным экраном
Точность регулирования температуры	±1°C
Расстояние скольжения	600 мм
<b>Плазменная установка RF</b>	
Выходная мощность	5 -500 Вт, регулируемая с ± 1% стабильности
Частота радиочастот	13,56 МГц ±0,005% стабильности
Мощность отражения	350 Вт макс.
Согласование	Автоматическое
Шум	
Охлаждение	Воздушное охлаждение.
<b>Блок точного контроля газа</b>	
Расходомер	Массовый расходомер MFC
Газовые каналы	4 канала

Расход	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCCMH4 MFC3: 0- 100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
Линейность	±0,5% F.S.
Повторяемость	±0,2% F.S.
Трубопровод и клапан	Нержавеющая сталь
Максимальное рабочее давление	0,45 МПа
Контроллер расходомера	Цифровой регулятор/контроллер с сенсорным экраном

**Стандартный вакуумный блок (опция)**

Вакуумный насос	Пластинчато-роторный вакуумный насос
Расход насоса	4L/S
Вакуумный порт всасывания	KF25
Вакуумметр	Кремниевый вакуумметр Пирани/Резистанс
Номинальное вакуумное давление	10Па

**Установка высокого вакуума (опция)**

Вакуумный насос	Пластинчато-роторный насос+молекулярный насос
Расход насоса	4L/S+110L/S
Порт всасывания вакуума	KF25
Вакуумметр	Комбинированный вакуумметр
Номинальное вакуумное давление	6x10-4Pa

Вышеуказанные спецификации и настройки могут быть настроены

Нет.	Описание	Количество
1	Печь	1
2	Кварцевая трубка	1
3	Вакуумный фланец	2
4	Тепловой блок трубки	2
5	Крючок трубчатого термоблока	1
6	Термостойкая перчатка	1
7	Источник радиочастотной плазмы	1
8	Точный контроль газа	1
9	Вакуумный блок	1
10	Руководство по эксплуатации	1

# Наклонная Вращающаяся Машина Печи Трубы PECVD Плазмы Усиленного Химического Осаждения

Артикул: KT-PE16



## введение

Передовая трубчатая печь PECVD для точного осаждения тонких пленок. Равномерный нагрев, источник ВЧ-плазмы, настраиваемый контроль газа. Идеально подходит для исследований полупроводников.

[Узнать больше](#)

Модель печи	PE-1600-60
Макс. температура	1600°C
Постоянная рабочая температура	1550°C
Материал трубки печи	Высокая чистота Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> трубки
Диаметр трубки печи	60 мм
Длина зоны нагрева	2x300 мм
Материал камеры	Японское глиноземное волокно
Нагревательный элемент	Дисилицид молибдена
Скорость нагрева	0-10°C/мин
Тепловая пара	тип В
Регулятор температуры	Цифровой ПИД-регулятор/ПИД-регулятор с сенсорным экраном
Точность регулирования температуры	±1°C
<b>RF плазменный блок</b>	
Выходная мощность	5 -500 Вт регулируемый с ± 1% стабильности
Частота радиочастот	13,56 МГц ±0,005% стабильности
Мощность отражения	350 Вт макс.
Согласование	Автоматическое
Шум	<50 дБ
Охлаждение	Воздушное охлаждение.
<b>Блок точного контроля газа</b>	
Расходомер	Массовый расходомер MFC
Газовые каналы	4 канала
Расход	MFC1: 0-5SCCM O <sub>2</sub> MFC2: 0-20SCCM CH <sub>4</sub> MFC3: 0- 100SCCM H <sub>2</sub> MFC4: 0-500 SCCM N <sub>2</sub>
Линейность	±0,5% F.S.

Повторяемость	±0,2% F.S.
Трубопровод и клапан	Нержавеющая сталь
Максимальное рабочее давление	0,45 МПа
Контроллер расходомера	Цифровой регулятор/контроллер с сенсорным экраном
<b>Стандартный вакуумный блок (опция)</b>	
Вакуумный насос	Пластинчато-роторный вакуумный насос
Расход насоса	4L/S
Вакуумный порт всасывания	KF25
Вакуумметр	Кремниевый вакуумметр Пирани/Резистанс
Номинальное вакуумное давление	10Па
<b>Установка высокого вакуума (опция)</b>	
Вакуумный насос	Пластинчато-роторный насос+молекулярный насос
Расход насоса	4L/S+110L/S
Порт всасывания вакуума	KF25
Вакуумметр	Комбинированный вакуумметр
Номинальное вакуумное давление	6x10 <sup>-5</sup> Pa
Вышеуказанные спецификации и комплектации могут быть изготовлены на заказ	

Нет.	Описание	Количество
1	Печь	1
2	Кварцевая трубка	1
3	Вакуумный фланец	2
4	Тепловой блок трубки	2
5	Крючок трубчатого термоблока	1
6	Термостойкая перчатка	1
7	Источник радиочастотной плазмы	1
8	Точный контроль газа	1
9	Вакуумный блок	1
10	Руководство по эксплуатации	1

# Наклонная Вращающаяся Машина Печи Трубки Pecvd Плазмы Усиленного Химического Осаждения

Артикул: KT-PED



## введение

Установка KINTEK для нанесения покрытий методом PECVD обеспечивает прецизионные тонкие пленки при низких температурах для светодиодов, солнечных батарей и МЭМС. Настраиваемые, высокопроизводительные решения.

[Узнать больше](#)

Держатель образца	Размер	1-6 дюймов
	Скорость вращения	0-20rpm регулируемый
	Температура нагрева	≤800°C
	Точность управления	±0,5°C ПИД-регулятор SHIMADEN
Газовая продувка	Расходомер	КОНТРОЛЛЕР МАССОВОГО РАСХОДОМЕРА (MFC)
	Каналы	4 канала
	Метод охлаждения	Охлаждение циркулирующей водой
Вакуумная камера	Размер камеры	Ф500mm X 550mm
	Порт наблюдения	Порт полного обзора с перегородкой
	Материал камеры	316 Нержавеющая сталь
	Тип двери	Дверь открытого типа спереди
	Материал крышки	304 Нержавеющая сталь
	Порт вакуумного насоса	Фланец CF200
	Порт впуска газа	Разъем ф6 VCR
Мощность плазмы	Мощность источника	Питание постоянного тока или радиочастотное питание
	Режим соединения	Индуктивная связь или емкостная пластина
	Выходная мощность	500 Вт-1000 Вт
	Мощность биаса	500v
Вакуумный насос	Предварительный насос	15L/S Лопастной вакуумный насос
	Порт турбонасоса	CF150/CF200 620Л/С-1600Л/С
	Порт сброса давления	KF25
	Скорость насоса	Лопастной насос: 15 л/с, турбонасос: 1200 л/с, 1600 л/с
	Степень вакуума	≤5×10-5Па
	Датчик вакуума	Ионизационный/сопротивление вакуумметр/пленочный манометр
Система	Электропитание	AC 220V /380 50Hz

Номинальная мощность	5 кВт
Размеры	900 мм X 820 мм X 870 мм
Вес	200 кг



## Kintek Furnace

Главный офис: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,  
Чжэнчжоу, Китай

WhatsApp or type unknown